

お客様各位

SEMICON JAPAN 2016 出展のご案内



株式会社 アークステーション

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様のご支援により弊社は「セミコンジャパン2016」に出展する運びとなりました。

今回の展示会では、各種技術サポート業務受託のご提案、取り扱い装置のご紹介を行います。

ご多忙中とは存じますが、ご来場の際は是非お立ち寄り下さい。心よりお待ちしております。 敬具

会 期： 2016年12月14日（水）～2015年12月16日（金） 10:00～17:00
会 場： 東京ビックサイト
主 催： SEMI

<見どころ>

1. 取り扱い製品のご紹介（ウェハ検査・計測装置）

150/200mmライン向け老朽化リプレース対象装置（新品・中古装置）

- ・NOVA社製膜厚測定装置
- ・Revera社製全自動XPS膜厚濃度測定装置
- ・東京航空計器社製重ね合わせ精度測定装置
- ・東朋テクノロジー社製卓上型膜厚測定装置
- ・東朋テクノロジー社製ストレス測定装置
- ・ZETA社製光学式3次元測定装置（ウェハエッジ部3次元計測・欠陥検査装置）
- ・ZETA社製透明ウェハ表裏欠陥検査装置
- ・中古装置（ナノメトリクス社製膜厚測定装置、ケーエルイー・テンコール社製欠陥検査装置）

2. 技術支援業務（保守業務委託／保守業務移管／エンジニア派遣）

3. 共同出展者

- ・株式会社ティエスティ 

<会場マップ> Hall 4 4909

